

課題番号 : F-16-OS-0059
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : 高精細集束イオンビーム装置による量子効果素子の開発
Program Title (English) : Development of quantum effect devices using high definition focused ion beam
利用者名 (日本語) : 小林 峰
Username (English) : Takane Kobayashi
所属名 (日本語) : 国立研究開発法人理化学研究所
Affiliation (English) : RIKEN

1. 概要 (Summary)

ビーム誘起デポジションによって作製したナノワイヤを高精細集束イオンビームにより加工することによって量子効果素子を製作できる可能性がある。その製作において、ヘリウムビームを用いるのと、ネオンビームを用いるのでは素子の特性に違いが現れる可能性がある。ネオンイオンビームで加工可能な装置は国内では大阪大学保有の高精細集束イオンビーム装置のみである。その為、実験実施に向けた研究打ち合わせを行ったが、試料の準備の都合で本年度は実施できなかった。

2. 実験 (Experimental)

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

4. その他・特記事項 (Others)

なし

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許 (Patent)

なし